

特 許 協 力 条 約

発信人：日本国特許庁（国際調査機関）

あて先 特許業務法人サカモト・アンド・パート ナーズ 様 〒160-0004 日本国 東京都新宿区四谷二丁目13番地	<h2 style="margin: 0;">P C T</h2> <p style="margin: 5px 0 0 0;">国際調査機関の見解書</p> <p style="margin: 5px 0 0 0;">(法施行規則第40条の2) [P C T 規則43の2.1]</p>	
出願人又は代理人の書類記号 18P0249	発送日 (日.月.年) 10.02.2020	
国際出願番号 PCT/JP2019/044576	国際出願日 (日.月.年) 13.11.2019	優先日 (日.月.年) 27.11.2018
国際特許分類 (IPC) B01J 19/08(2006.01)i; C01B 3/06(2006.01)i; C01B 6/04(2006.01)i; H05H 1/46(2006.01)i FI: B01J19/08 E; C01B3/06; C01B6/04; H05H1/46 B		
出願人 (氏名又は名称) 株式会社エスイー		

1. この見解書は次の内容を含む。

- 第I欄 見解の基礎
- 第II欄 優先権
- 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
- 第IV欄 発明の単一性の欠如
- 第V欄 新規性、進歩性及び産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に基づく見解並びにその見解を裏付ける文献及び説明
- 第VI欄 ある種の引用文献
- 第VII欄 国際出願の欠陥
- 第VIII欄 国際出願についての意見

2. 今後の手続

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 〒100-8915 日本国 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	見解書を作成した日 27.01.2020	権限のある職員（特許庁審査官） 池田 周士郎 4Q 3909 電話番号 03-3581-1101 内線 3421
--	-------------------------	--

第 I 欄

見解の基礎

1. 言語に関し、この見解書は以下のものに基づき作成した。

- 出願時の言語による国際出願
 出願時の言語から国際調査のための言語である _____ 語に翻訳された、この国際出願の翻訳文（PCT規則12.3(a)及び23.1(b)）

2. この見解書は、PCT規則91の規定により国際調査機関が許可した又は国際調査機関に通知された明らかな誤りの訂正を考慮して作成した（PCT規則43の2.1(b)）。

3. この国際出願で開示されたヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、以下の配列表に基づき見解書を作成した。

a. 出願時における国際出願の一部を構成する配列表

附属書C/ST.25テキストファイル形式

紙形式又はイメージファイル形式

b. 国際出願とともに、PCT規則13の3.1(a)に基づき国際調査のためにのみ提出された、附属書C/ST.25テキストファイル形式の配列表

c. 国際出願日後に、国際調査のためにのみ提出された配列表

附属書C/ST.25テキストファイル形式（PCT規則13の3.1(a)）

紙形式又はイメージファイル形式（PCT規則13の3.1(b)及びPCT実施細則第713号）

4. さらに、複数の版の配列表又は配列表の写しが提出され、変更後の配列表又は追加の写しに記載された情報が、出願時における配列表と同一である旨、又は出願時における国際出願の開示の範囲を超えない旨の陳述書の提出があった。

5. 補足意見：

第V欄 新規性、進歩性及び産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に基づく見解並びにその見解を裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求項	1-8	有
	請求項		無
進歩性 (IS)	請求項	7-8	有
	請求項	1-6	無
産業上の利用可能性 (IA)	請求項	1-8	有
	請求項		無

2. 文献及び説明:

文献1 : US 2008/0173641 A1 (HADIDI, Kamal, et al.) 24.07.2008(2008-07-24)
 [0022]-[0053],[0066],Figures.1-5
 & US 2014/0287162 A1
 & WO 2008/121173 A2
 文献2 : JP 2008-181710 A (キヤノン株式会社) 07.08.2008(2008-08-07)
 [0007],[0021],[0042],[0054]
 & US 2008/0173402 A1
 [0009],[0033],[0063],[0080]
 文献3 : JP 2012-188701 A (財団法人神奈川科学技術アカデミー) 04.10.2012(2012-10-04)
 [0058]-[0060],[0064],図7-8 (ファミリーなし)
 文献4 : JP 2016-216780 A (株式会社エスイー) 22.12.2016(2016-12-22)
 [0025],図2-B (ファミリーなし)
 文献5 : JP 11-333288 A (スタンレー電気株式会社) 07.12.1999(1999-12-07)
 [0115]-[0118],図20
 & EP 960914 A1
 [0121]-[0124],図20
 文献6 : JP 2011-058064 A (国立大学法人北海道大学) 24.03.2011(2011-03-24)
 [0031],図2 (ファミリーなし)
 文献7 : JP 2011-032131 A (バイオコーク技研株式会社) 17.02.2011(2011-02-17)
 全文,全図 (ファミリーなし)
 文献8 : JP 2017-073375 A (アルファ株式会社) 13.04.2017(2017-04-13)
 全文,全図 (ファミリーなし)
 文献9 : US 2004/0060387 A1 (TANNER-JONES, Jeffrey) 01.04.2004(2004-04-01)
 全文,全図
 & WO 2002/046482 A1
 & EP 1348038 A1
 & AU 2035802 A
 & ZA 200305088 B

請求項1に係る発明は国際調査報告で引用された文献1-3に対して進歩性を有しない。
 文献1には、処理物質22にプラズマを照射するプラズマチャンバ18と(本願発明の処理室に相当)、
 プラズマ中に処理物質22を供給する物質供給システム20と(本願発明の原料供給部に相当)、
 反応性ガス26を供給するガス供給源24と(本願発明のガス供給部に相当)、
 マイクロ波供給部16と(本願発明のマイクロ波供給部に相当)、
 プラズマチャンバに導入するマイクロ波を通す誘電材料から構成されたプラズマチャンバ側壁と
 (本願発明の誘電体の窓に相当)、
 を備えたマイクロ波プラズマ処理装置であって、前記マイクロ波供給部16は、約1kW以上の電力でマイクロ波を発生するマイクロ波プラズマ処理装置が記載されている([0022]-[0053],[0066],図1-5を参照)。

文献1には、上記電力が2.0キロワット以上であることは記載されていない。
 しかし、上述したように文献1には、約1kW以上の電力でマイクロ波を発生させることが記載されているから([0050])、その範囲は本願発明と重複している。そして、当該技術分野において、

第V欄

新規性、進歩性及び産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に基づく見解並びにその見解を裏付ける文献及び説明

このようなマイクロ波電源の電力を2 kW以上とすることは周知の技術（文献2の[0007], [0021], [0042], [0054], 文献3の[0058]-[0060], 図7等を参照）であるから、その具体的な電力を2 kW以上とすることに格別の困難性は認められない。

請求項2に係る発明は国際調査報告で引用された文献1-3に対して進歩性を有しない。

文献1には、物質供給システムには気化装置を用いてもよいことが記載されている（[0066]）。そして、処理物質を気化するために加熱部を設けることは例示するまでもなく周知の技術である。

請求項3に係る発明は国際調査報告で引用された文献1-4に対して進歩性を有しない。

文献1には、基板102は粉末回収手段でもあることが記載されている（[0045]）。また、当該技術分野において、このような基板周辺に加熱手段を設けることは周知の技術であり（一例として、文献4の[0025], 図2-B等を参照）、文献1の基板周辺に加熱手段を設け、その温度を制御することは実施に際し当業者が適宜設定し得る事項にすぎない。

請求項4-5に係る発明は国際調査報告で引用された文献1-3に対して進歩性を有しない。

文献1には、物質供給システムには流動層粉末フィーダを用いてもよいこと（[0066]）、及び基板102は粉末回収手段でもあること（[0045]）が記載されている。

請求項6に係る発明は国際調査報告で引用された文献1-5に対して進歩性を有しない。

当該技術分野において、このような処理室の前後に前室及び後室を設けること、及び搬送部を設けることは周知の技術である（文献3の[0064], 図8, 文献5の[0115]-[0118], 図20を参照）。

請求項7に係る発明は国際調査報告で引用された文献1-9に対して新規性及び進歩性を有する。

いずれの文献にも、本願請求項7記載の構成を有するマイクロ波プラズマ処理装置は記載されておらず、その点は当業者といえども容易に想到し得ない。

請求項8に係る発明は国際調査報告で引用された文献1-9に対して新規性及び進歩性を有する。

文献1には、上記マイクロ波プラズマ処理装置を、原料に無水のハロゲン化物を用いた水素化マグネシウムの製造方法に適用することは記載も示唆もされていない。この点につき文献2-9は一般的技術水準を示すものである。